

SP-16300D



## ・特徴

粉粒体、小片、小球等、基材同士が接触しても問題のない場合の成膜に適しています。回転バレル内に収納(最大収納量 20000cc)された基材は、バレル内で混合され、基材の全表面に成膜できます。

## ・仕様

到達圧力	×10 <sup>-4</sup> Pa 台※常温・無負荷・脱ガス時
排気速度	×10 <sup>-4</sup> Pa 台迄 30 分以内※常温・無負荷・脱ガス時
成膜室径	φ950mm×1800mmL SUS304 電解研磨
スパッタ用電源	DC 電源 700V 6.3KW 1 台
基板形状	粉・粒体 20000cc
膜厚分布	—
ターゲット寸法	150mm×1270mm(金属)
ターゲット個数	1
基板回転	バレル(φ600mm×1400mmL)横型回転
基板加熱	常温~120℃迄昇温可能
真空排気系	油回転ポンプ：1300L/min メカニカルブースターポンプ：600m <sup>3</sup> /h 油拡散ポンプ：6300L/sec
操作方法	自動
ガス系統	マスフローコントローラ 1 系統
ユーティリティ	電気：AC200V 三相 160KVA 冷却水：100L/min 以上 0.1MPa 以上 0.15MPa 以下 25℃以下循環 計装エア：0.5MPa 以上 設置寸法：10000mmW×8000mmD×1800mmH